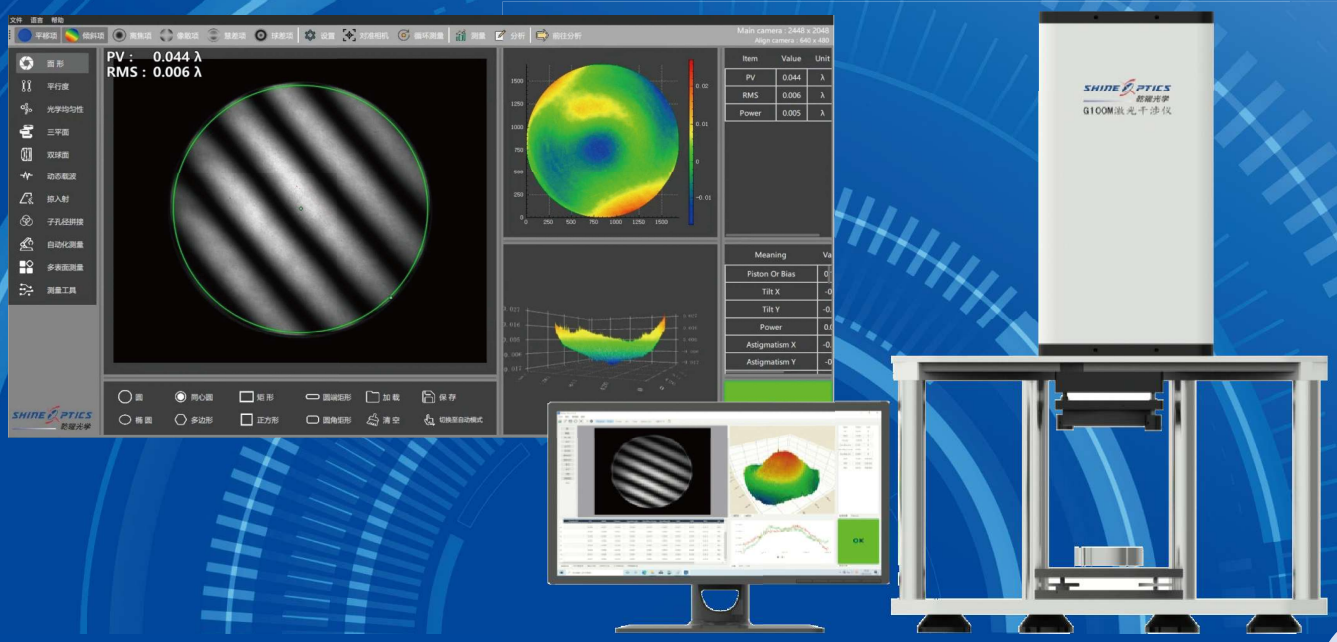
レーザー平面干渉計G100M

中国の光学機器の大手メーカーであるSHINE OPTICS社の
高品質で低価格なレーザー平面干渉計G100Mをご紹介します。



100mmの有効開口を備えたG100Mは、正立式構造を採用し平面部品の平置き測定・高精度測定に適します。
高性能で長寿命のレーザー・高解像度の光学系・1～6倍の画像拡大機能・精密な平面標準ミラーなど
最先端の技術を結集して高精度な平面光学部品の測定を実現します。
また位相シフト干渉縞解析ソフトウェア「Sirius」を搭載し測定精度と効率を向上します。
測定デモやお客様のニーズに合わせたカスタマイズのご相談などお気軽にお問い合わせください。

詳細はこちら!!

型番	G100M	測定方法	フィゾーの干渉原理
有効通光口径	101.6mm	光源	He-Neレーザー
カメラ	1/1.2インチ, 有効画像数1.2K×1.2K	横解像度	全口径分解能ストライプ数＞300セット
測定モード	Sirius耐振機械位相シフトFPSIとPSI	変倍Zoom	光学ズーム連続可変1X-6X 小サイズも正確に測定できます。
RMS簡易繰り返し性 （2σ）	＜λ/3000	RMS波面繰り返し性 （mean+2σ）	＜0.6nm
アライメント方式	高速デジタルアライメントシステムDAS アライメント角度±3°	瞳焦点調整範囲	±2.5M
平面透過基準レンズ	石英、PV＜λ/20	平面反射基準レンズ	微結晶、PV＜λ/20
システム精度	PV＜λ/20	電源	100-240VAC, 50/60Hz
干渉キャビティ内寸法 （長さ×幅×高さ）	540×360×360mm	機器寸法 （長さ×幅×高さ）	640×400×1100mm
作業環境温度	15℃-30℃	湿度	≤ 70%
温度変換	＜0.5℃/h	機器重量	90KG
防振	機械位相シフト測定モードの時は 受動防振システムを使用してください。	品質基準	GJB/J6221-2008

当社にて測定デモが可能ですのでお問い合わせください。

株式会社渋谷光学
〒351-0111 埼玉県和光市下新倉3丁目22番2号
TEL: 048-469-1200 / FAX: 048-469-1311